

科学研究費助成事業(科学研究費補助金)研究成果報告書

平成25年5月31日現在

機関番号:33910
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2010~2012
課題番号:22560309
研究課題名(和文)AIGaN/GaNヘテロ接合界面のバンド構造解析と高品質化
研究課題名(英文)Band-gap states and quality analyses of AlGaN/GaN hetero-structures
研究代表者 中野 由崇 (NAKANO YOSHITAKA) 中部大学・総合工学研究所・准教授 研究者番号:60394722

研究成果の概要(和文): AlGaN/GaN ヘテロ構造の GaN バッファ層の MOCVD 結晶成長温度が低い 程(1120~1170℃)、炭素取り込み量が多くなり、伝導帯下 2.07, 2.80, 3.23eV に欠陥準位が顕 在化する傾向を示す。これらの欠陥準位は Ga 空孔, Ga 空孔-炭素,炭素に帰属するものと思わ れる。また、2.80eV と 3.23eV の欠陥準位は 2 次元電子ガスのキャリアトラップとして働くこ とがわかった。

研究成果の概要(英文): In conventional AlGaN/GaN hetero-structures grown by MOCVD, the C impurity incorporation was enhanced with decreasing the growth temperature of the GaN buffer layer between 1120 and 1170°C. Concurrently, deep-level defects became dense at 2.07, 2.80, and 3.23eV below the conduction band, presumably attributable to Ga vacancies and shallow C acceptors in the GaN buffer layer. Among them, the 2.80 and 3.23eV levels are found to be strongly responsible for the carrier-trapping phenomena in the AlGaN/GaN hetero-structures.

交付決定額

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2010年度	1, 700, 000	510,000	2, 210, 000
2011年度	1,000,000	300, 000	1, 300, 000
2012年度	700,000	210,000	910,000
年度			
年度			
総 計	3, 400, 000	1,020,000	4, 420, 000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学、電子・電気材料工学 キーワード:電気・電子材料、窒化物半導体、半導体物性、結晶工学

1. 研究開始当初の背景

(1) 無線通信システムのキーデバイスであ る高周波パワーデバイスの高性能化が要求 されている。従来のSi系やGaAs系デバイス の限界を打破するため、バンドギャップが大 きい窒化物半導体をベースとした AlGaN/GaN HEMT(高移動度トランジスタ)の実用化が急 務となっている。AlGaN/GaN ヘテロ界面では、 強力な内部電界により 10¹³ cm⁻² オーダーの極 めて高濃度の2次元電子ガスを利用できるため消費電力の超低損失化が可能となる。このような背景のもと、米国・日本において活発に研究・開発が行われている。

(2) しかし、結晶材料中に存在する欠陥準 位の存在により、実デバイスの高出力動作時 にスイッチング特性が不安定となる電流コ ラプスの問題が顕在化しており、実用化への 障害となっている。

(3) これまで、AlGaN層の表面準位を表面処 理や保護膜形成で不活性化することやゲー ト電極をフィールドプレート構造化し電界 集中を緩和することで、電流コラプス現象を 7~8割程度まで低減できているが、依然とし て電流コラプスを完全に抑制・排除するには 至っていない。したがって、AlGaN/GaN HEMT の実用化には、残された電流コラプスの原因 解明とその対策が急務となっている。

2. 研究の目的

(1) 単色分光励起による光容量の過渡応答 特性から欠陥準位を計測する容量 DLOS 計測 技術を高度化し、A1GaN/GaN ヘテロ構造の欠 陥準位評価に適用する。

(2) A1GaN/GaN ヘテロ構造における炭素関 連の欠陥準位の形成挙動に焦点を絞りなが ら、多様な結晶性を有するヘテロ構造のバン ド構造解析を行い、ヘテロ界面近傍のバンド ギャップ電子状態を系統的に調査する。

(3) 半導体欠陥物性の視点から、欠陥準位と 電流コラプス現象との相関を検証すると同 時に、電流コラプスの低減を目的に AlGaN/GaN ヘテロ構造の高品質化のための結 晶成長への材料設計指針を抽出する。

3. 研究の方法

(1) 窒化物半導体のワイドバンドギャップ に対応するため、長波長領域から短波長領域 までの単色分光照射が可能なミックス光源 を導入し、容量 DLOS 計測技術の高精密化を 図る。

(2) 容量 DLOS 計測によるバンド構造解析を 主要ツールとして、A1GaN/GaN ヘテロ構造で の炭素関連の欠陥準位の形成挙動に焦点を 絞りながら、多様な結晶性を有する A1GaN /GaN ヘテロ構造のバンドギャップ電子状態 を明らかにする。

(3) 欠陥準位のエネルギー深さを考慮した ターンオン電流回復特性の光照射波長依存 性から、欠陥準位とデバイス・スイッチング 特性の相関を検討する。

4. 研究成果

(1) 励起用光源として、ハロゲンと重水素 のミックス光源を用いることで単色分光波 長範囲を1600~300nmに広げ、更に単色分光 ビームを集光化することで、AlGaN/GaN ヘテ ロ構造に存在する深い欠陥準位を高精度・高 感度に検出できる容量 DLOS 計測装置を作製 した(図 1)。



図1. 高精度化した容量 DLOS 計測システムの構成

(2) 電流コラプス量が大きく異なる A1GaN/GaN ヘテロ構造を結晶成長後、プレー ナー型ショットキーデバイスを作製し、フォ トルミネッセンス(PL)測定,容量-電圧測定, 容量 DLOS 測定から、電流コラプス量が大き い程、伝導帯下2.07,2.80,3.23 eV に位置 する3つの欠陥準位が顕在化することが分か った(図2)。また、これらの欠陥準位濃度は はPL のイエローバンド強度と同様の傾向を 示すことから、不純物炭素の取り込みに起因 する Ga 空孔, Ga 空孔-炭素,炭素に帰属する 欠陥準位であると思われる(図3)。







図 3. 電流コラプス量の異なる Al GaN/GaN ヘテロ構造の室温 PL スペクトル

(3) GaN バッファ層の MOCVD 結晶成長条件 (成長温度, V/III 原料比)をパラメータとし た多様な結晶性を有する AlGaN/GaN ヘテロ構 造を作製し、GaN バッファ層に不純物である 炭素が残存する程、炭素取り込みに起因する 上記の3つの欠陥準位濃度が増加することを 再確認した(図4)。



図 4. 残存炭素量の異なる Al GaN/GaN ヘテロ 構造の光容量スペクトル

(4) デバイスのオフ状態からのターンオン 時の電流回復特性の光照射波長依存性から、 伝導帯下2.80eVと3.23eVに存在する炭素関 連の欠陥準位が2次元電子ガスのキャリアト ラップとして働き、室温でのスイッチング特 性を支配していることが分かった(図 5(a),(b))。



図 5. ターンオン電流回復特性の光照射波長 依存性

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計4件)

- Y. Nakano, Y. Irokawa, Y. Sumida, S. Yagi, H. Kawai, Correlation between deep-level defects and turn-on recovery characteristics in AlGaN/GaN hetero-structures, Journal of Applied Physics 112(10), 106103 (2013), 査読 有, DOI: 10.1063/1.4767367.
- ② Y.Nakano, Y.Irokawa, Y.Sumida, S.Yagi, H.Kawai, Effect of Carbon Impurity Incorporation on Band-Gap States in AlGaN/GaN Hetero-Structures, Electrochemical and Solid-State Letters 15(2), HH44-HH46 (2011), 査読 有, DOI: 10.1149/2.025202es1.
- (3) Y.Nakano, Y.Irokawa, Y.Sumida, S.Yagi, H. Kawai, Photo-Capacitance Spectroscopy Investigation of A1GaN/GaN Deep-Level Defects in hetero-structures with different current collapses, Physica Status Solidi (RRL) 4(12), 374-376 (2010), 査 読有, DOI: 10.1002/pssr.201004421.

〔学会発表〕(計8件)

① <u>Y.Nakano</u>, Correlation between

Deep-LevelDefectsandCurrentCollapsesinAlGaN/GaNHetero-Structures(招待講演), 11thInternationalSymposium onAdvancedTechnology, 2012年10月31日, 工学院大学(東京).

- ② Y.Nakano, Y.Irokawa, Y.Sumida, S.Yagi, H.Kawai, Correlation between turn-on recovery characteristics and deep-level defects in AlGaN/GaN hetero-structures, International Workshop on Nitride Semiconductors 2012, 2012年10月16日, 札幌コンベ ンションセンター(札幌) Sapporo.
- ③ Y. Nakano, Y. Irokawa, Y. Sumida, S. Yagi, H. Kawai, Correlation between Current Collapses and Deep-Level Defects in AlGaN/GaN Hetero -Structures Probed by Photo-Capacitance Spectroscopy, 9th International Conference on Nitride Semiconductors, 2011 年 7 月 13 日, Scottish Exhibition and Conference Centre (Glasgow, UK).
- 〔図書〕(計1件)
- <u>中野由崇</u>(分担執筆)、第4章第2節 「AlGaN/GaN ヘテロ構造の欠陥準位評価」、 GaN パワーデバイスの技術展開(S&T 出 版)、2012年4月、総ページ 264(p.127-136).

〔産業財産権〕

○出願状況(計1件)

- 名称:ワイドギャップ半導体のバンドギャッ プ電子物性測定方法及び測定装置 発明者:<u>中野由崇</u>、中村圭二 権利者:同上 種類:特許 番号:特願 2012-168032
- 出願年月日:24年7月30日 国内外の別:国内

[その他]

ホームページ等 http://www.chubu.ac.jp/about/faculty/pr ofile/18fda985f369f45f4e48e0e57ab46fa44 1142616.html

6.研究組織
 (1)研究代表者
 中野 由崇 (NAKANO YOSHITAKA)
 中部大学・総合工学研究所・准教授
 研究者番号:60394722

(2)連携研究者色川 芳宏(IROKAWA YOSHIHIRO)

物質・材料研究機構・主任研究員 研究者番号:90394832